## SOI-MEMS 環境振動発電素子に向けた 自己組織化エレクトレットの電気的特性に関する検討

## A Study on Electrical Characteristics of Self-Assembled Electrets

## for SOI- MEMS Vibrational Energy Harvesters

立命館大1, 群馬大2

°(M1) 砂川 優一朗<sup>1</sup>, 角野 響一<sup>1</sup>, 細井 覚<sup>1</sup>, 李 睿宸<sup>1</sup> 田中 有弥2, 山根 大輔1

Ritsumeikan Univ.<sup>1</sup>, Gunma Univ.<sup>2</sup>

°Yuichiro Sunagawa<sup>1</sup>, Kyoichi Kakuno<sup>1</sup>, Satoru Hosoi<sup>1</sup>, Ruichen Li<sup>1</sup>, Yuya Tanaka<sup>3</sup>, and Daisuke Yamane<sup>1</sup> E-mail: dyamane@fc.ritsumei.ac.jp

はじめに 静電型 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 環境振動発電素子 (VEH: Vibrational Energy Harvester) は、小型無線センサ端末の自立電源応用等に向けて有用である[1]。近年、当研 究グループは、荷電処理が一切不要な自己組織化エレクトレット (SAE: Self-Assembled Electret) [2]を用いて MEMS VEH[3]を実現した。さらに、製造プロセスを簡素化できることから SOI ウェ ハを用いた SAE MEMS-VEH の開発を進めている。本研究では、SOI ウェハに形成した中空構造 内部に成膜した SAE について、電気的特性の解析モデルを検討したので報告する。

モデル検討 SAE MEMS-VEH[3]では、可動電極に形成されたスルーホールを介して、マイクロパ ターン化した SAE(μ-SAE)を固定電極上に真空蒸着法により成膜する。本研究では、μ-SAE の 単位セルを直方体と近似し、Si 基板上に SAE を配置した 3D モデル(図1)を検討する。電気特性 評価として、SOI ウェハのデバイス層を想定した評価面の電位分布について、有限要素法を用い たシミュレーションを実施した。なお、SAE は Alq₃ (tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum) とした。

実験結果 今回のシミュレーションでは、有限要素法シミュレータである COMSOL Multiphysics 6.2 を用いた。シミュレーション結果の一例を図2に示す。図2では、評価面と基板の距離を10μm、 SAE の膜厚を 1  $\mu$ m とした。シミュレーションの結果、SAE の表面電荷密度が 1.4  $\mu$ m とした。 [2]、評価面の電位の最大値は 40.6 V であった。

結論と今後の展望 SOI を用いた中空構造内部に SAE を成膜した際の電気的特性について、解析 モデルを検討した。解析モデルを検討し、デバイス層の電位分布を評価し、SOI を用いた SAE MEMS-VEH の実現に向けたシミュレーション環境構築の見通しを得た。今後、SAE の電気的特性 について、シミュレーション結果と実測結果を比較し、妥当性を検証する。

**謝辞** 本研究は JST A-STEP JPMJTR22R5、JSPS 科研費 22H01929、サムコ科学技術振興財団、三 豊科学技術振興協会、東京エレクトロン共同研究公募制度、立命館大学立命館先進研究アカデミ ー(RARA)を受けたものである。

参考文献 [1] H. Toshiyoshi et al., Sci. Technol. Adv. Mater. 20, 124-143 (2019), [2] Y. Tanaka et al., Sci. Rep. 10, 6648 (2020), [3] D. Yamane et al., Appl. Phys. Lett. 119, 254102 (2021)

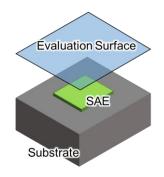


Fig.1. Simulation model

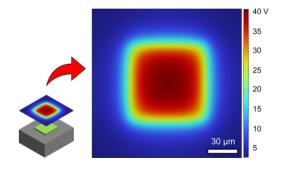


Fig. 2. Potential on evaluation surface